

Title (en)

MICROFLUIDIC FLOW CELL WITH INTEGRATED ELECTRODE AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

Title (de)

MIKROFLUIDISCHE FLUSSZELLE MIT INTEGRIERTER ELEKTRODE UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG

Title (fr)

CELLULE D'ECOULEMENT MICROFLUIDIQUE COMPRENANT UNE ELECTRODE INTEGREE ET SON PROCEDE DE FABRICATION

Publication

EP 3199240 A1 20170802 (DE)

Application

EP 16152755 A 20160126

Priority

EP 16152755 A 20160126

Abstract (en)

[origin: WO2017129340A1] The invention relates to a microfluidic flow cell comprising an electrode (16, 19, ...) or sensor device (39) which is located inside the flow cell and from which at least one connecting conductor (15, 18, ...) leads to an externally accessible terminal contact. According to the invention, the electrode (16, 19, ...) or sensor device (39) is arranged on an insulated substrate member, the connecting conductor (15, 18, ...) is embedded in the substrate member, and the substrate member can be inserted into an opening (8) in the flow cell such that the electrode (16, 19, ...) or sensor device (39) is placed in the flow cell.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft eine mikrofluidische Flusszelle mit einer innerhalb der Flusszelle angeordneten Elektrode (16,19, ...) oder Sensoreinrichtung (39), von der wenigstens ein Anschlussleiter (15,18, ...) zu einem von außen zugänglichen Anschlusskontakt geführt ist. Erfindungsgemäß ist die Elektrode (16,19, ...) oder Sensoreinrichtung (39) auf einem isolierenden Trägerkörper angeordnet, der Anschlussleiter (15,18, ...) in den Trägerkörper eingebettet und der Trägerkörper unter Anordnung der Elektrode (16,19, ...) oder Sensoreinrichtung (39) in der Flusszelle in eine Öffnung (8) in der Flusszelle einsetzbar.

IPC 8 full level

B01L 3/00 (2006.01); **H01B 17/30** (2006.01)

CPC (source: EP US)

B01L 3/502707 (2013.01 - US); **B01L 3/502715** (2013.01 - EP US); **B01L 2200/0689** (2013.01 - EP US); **B01L 2300/042** (2013.01 - EP US); **B01L 2300/046** (2013.01 - EP US); **B01L 2300/0645** (2013.01 - EP US); **B01L 2300/0663** (2013.01 - EP US); **B01L 2300/0877** (2013.01 - EP US)

Citation (applicant)

WO 2015001070 A1 20150108 - THINXXS MICROTECHNOLOGY AG [DE]

Citation (search report)

- [XII] DE 19602861 A1 19970731 - KNOLL MEINHARD PROF DR [DE]
- [X] DE 102006038271 A1 20080214 - SENSLAB GES ZUR ENTWICKLUNG UN [DE]
- [X] EP 2169391 A1 20100331 - IBIDI GMBH [DE]
- [AD] WO 2015001070 A1 20150108 - THINXXS MICROTECHNOLOGY AG [DE]

Cited by

US12005444B2; WO2020012263A1

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

EP 3199240 A1 20170802; CN 108495713 A 20180904; CN 108495713 B 20210709; US 11433393 B2 20220906; US 2019022646 A1 20190124; WO 2017129340 A1 20170803

DOCDB simple family (application)

EP 16152755 A 20160126; CN 201680079923 A 20161228; EP 2016082748 W 20161228; US 201616070125 A 20161228